日本機械学会論文集(B 編) 70 巻 694 号(2004-6)

# 二相閉ループ型熱サイフォンによる CPU の冷却に関する実験的研究\*

## An Experimental Study on Cooling of CPU using a Two Phase Closed Thermosyphon Loop

Satoru GIMA\*\*, Takashi NAGATA, Xing ZIIANG and Motoo FUJII

\*¹ Department of Mechanical Systems Engineering, University of the Rydkyus, 1 Senbaru, Nishihara cho, Okmawa, 903-0213 Japan

This paper reports on indirect cooling of high power CPU of notebook computers using a two phase closed thermosyphon loop with Fluorinert (FC 72) as the working fluid. The experimental set up consists of an evaporator and a condenser connected by flexible tubing. The evaporator corresponds to a high power CPU, and the condenser represents a cooling plate located behind the display of notebook computer. The evaporator and the condenser have the outer dimensions of 50 mm  $\geq$  50 mm  $\geq$  20 mm and 150 mm  $\geq$  20 mm  $\geq$  20 mm, respectively. The effects of the heat input Q and the charged volume of Fluorinert liquid F on the heat transfer characteristics of the cooling system were studied experimentally. Further, the experiments using several types of evaporators to enhance the boiling in the evaporator were carried out. It has been confirmed that the back surface temperature of the evaporator with plate lin of roughness surface by blast (Type D) reduces about 18% in comparison with that of the evaporator without fin (Type A). In the case of the evaporator Type D, the temperature difference between the evaporator back surface and ambient is kept around 55 K for the highest heat input Q = 30 W in the present experiments.

Key Words: Electronic Equipment, Thermosyphon, Heat Transfer Enhancement, Heat Transfer, Notebook Computer, Two Phase Flow, Fluorinert, Blast

#### 1. 維 常

近年、電子機器の発熱量が急速に増大しており、ノート型パソコンでも CPU チップ当たりの発熱量は 30Wを超えようとしている<sup>10</sup>、現在のノート型パソコンの冷却方法としてはファンやヒートバイプを用いたものがほとんどで、このような発熱量の増大に対応できなくなりつつあり、高性能な冷却技術の開発が求められている<sup>10</sup>、また、高い信頼性、低騒音の機器への要ソコンの冷却においては、CPU で局所的に発生する熱を追することが重要となった。 高温力電子機器を一様に近づける場別に対応するため、高出力電子機器を一様に近づける場別に対応するため、高出力電子機器の冷却に関しては、冷葉の循環による液体冷却に関する研究が最近活発に行われている (ローロ)・ノート型パソコンの冷却に関して、近藤ら(のはポンプを用いて関

ループ内の冷却水を循環させて CPU からの熱をノート 型パソコンの液晶ディスプレイ背面へ移動させるシス テムを開発した。これは将来の冷却技術の一つとして 注目を浴びている<sup>(a)</sup>が、ポンプや水を使用しているた め、信頼性や水瀬れ等に問題があると思われる。

著者らいかへいかはより高度な信頼性、低騒音への要求に応えるため、ノート型パソコンに搭載された CPU の冷却について、三相関ループ型熱サイフォンを用いた自然循環方式による冷却に関する実験を行った。冷媒としては電気絶縁性流体であるフロリナート(FC-72)を用いている。したがって、液漏れが発生したとしても短絡の危険がなく、また、ポンプを使用しないため騒音はない。

本報はCPUを模擬したヒータへの供給電力およびループ内への充填液量を変化させ、また、沸騰伝熱促進を目的に、蒸発器内部の伝熱面状態を4種類に変えた実験も行い、二相閉ループ型熱サイフォンの冷却性能を明らかにしたものである。CPU 湿度に対応する蒸発器裏面温度におよぼす熱量、液量および蒸発器形状の影響を実験的に明らかにする。

<sup>\*</sup> 原稿受付 2003年9月29日.

<sup>\*\*</sup> 正員, 玻球大学工学部(#903-0213 沖縄県西原町学千原工)。

<sup>\*\*</sup> 正真, 九州大学先專物智化学研究所(墨 816 8580 春日)市春 日公園 6~1)。

E-mail: gima@tec.u-ryukyu.ac.jp

### おもな記号

- F 閉ループ内の充填液量 cc
- Q ヒータへの供給電力 W
- q 熱流束 W/m²
- R 液の充填率
- T 温度 K
- 7. 蒸発器裏面温度 K
- T. 周囲温度 K
- 7. 飽和温度 K
- ΔI 周囲との温度差 (=I-I)
- Δ7... 伝熱面過熱度 (=7,-7...) K
- θ 熱抵抗 (=(T<sub>1</sub>-T<sub>2</sub>)/Q) K/W

#### 2. 実験装置および方法

図1に実験装置の概略を示す。装置はノート型パソコンの CPU 部に対応する蒸発器とディスプレイ背面の放熱板に対応する凝縮器およびそれらをつなぐチューブからなり。系は閉ループを構成している。熱サイフォン作用でループ内を観撃するフロリナートが沸騰と凝縮を繰り返すことにより CPU が冷却される。ノート型パソコンの液晶ディスプレイを模擬した凝縮器の姿勢については、傾斜角度を種々変化させても放熱特性に明確な差異が見られなかった(い)へ(い) ため鉛直とした。なお、凝縮器の側面はアクリル板で閉じられている。

図 2 に凝縮器の概略を示す、凝縮器は縦 150mm, 横 200mm, 厚さ 10mm の鋼板の中央部を図のように深さ 3mm に切削し、その上面を厚さ 10mm のアクリル板でネジ止めしたものである、鋼板とアクリル板との接触面には真空用グリスを塗布した厚さ 0.5mm のシリコンシートをパッキンとして挟み込んでいる。鋼板には閉ループを構成するため、外径 4.8mm, 内径 3.1mm の鋼管が左上部および中央下部にはんだ付けされている。右上部には凝縮器内の温度および圧力を測定するための外径 3mm, 内径 2mm の鋼管がはんだ付けされている。なお、周囲への放熱部となる凝縮器裏面(鋼板面側)には黒体塗料が塗布されている。

本実験においては Type A~D の 4 種類の蒸発器を製作した. Type A は蒸発器内の伝熱面が平滑面の場合, Type B は器内にプレートフィンがある場合, Type C は Type A の平滑面にブラスト加工を施した場合. Type D は Type B のフィンにブラスト加工を施した場合である. なお, ブラスト加工は表面最大粗さが約50μm と約70μm の 2 種類を用い, それぞれ Type C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub> とする. Type D の場合の加工粗さは約70μm であり,フィン側面にも加工した. ブラスト材料としてスチールグリッド#70を用い,空気圧 4kg/cm²,ブラスト距離

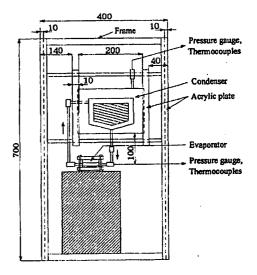


Fig. 1 Schematic of experimental apparatus

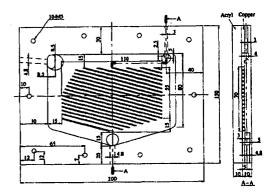


Fig. 2 Schematic of condenser

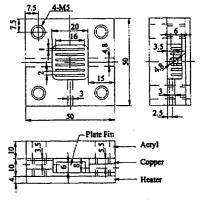
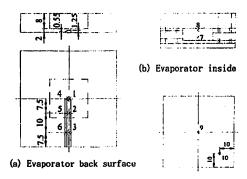


Fig. 3 Schematic of evaporator (Type B, D)

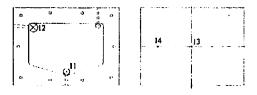
20cm として加工した. 図 3 に代表例として Type B(D) の蒸発器の概略を示す。 図中のプレートフィンがない 状態のものが Type A(C)の蒸発器に相当する. なお, Type A の平滑面蒸発器の場合の表面最大粗さは約 3 μm であった。基本構造は疑縮器と同じで鋼板とアクリル 板からなる. 縦横 50mm, 厚さ 10mm の銅板中央部に縦 横 20mm, 深さ 8mm の空洞部がある. この空洞部の面の 状態をType A~D の4種類に変化させている。左右に は閉ループを構成するための流出入部として外径 4.8mm, 内径 3.1mm の鋼管がはんだ付けされており、 それらにはループ内の循環を良くするため高さ 2mm の 高低差がある. 図において、凝縮器からの液が右側か ら流入し、蒸発器内での蒸気は左側から流出していく. また、銅板側面には蒸発器内の圧力を測定するためと フロリナートを閉ループ内に充填するための外径 3mm, 内径 2mm の鋼管がはんだ付けされている. 蒸発器下部 にはヒータが両面テープで接着されている。ただし、 ・ヒータと蒸発器との接触を良くするため、それらはボ ルトナットを用いて上下方向から強く固定されている. フロリナートの充填は閉ループ内を十分真空引きした 後に行い、充填量はビュレットにより測定される.

温度測定には外径 0.5mmの K 型シース熱電対を用いた. 図 4(a) ~ (e) に熱電対股度位置を×印で示す. No.1~6 および No.13, 14 は蒸発器および凝縮器の銅板裏面に銀ペーストで接着している. No.7, 8, 11, 12 は蒸発器および凝縮器内にコンプレッションフィッティングを用いて挿入されており、器内の気液温度を測定することができる. なお、周囲温度は蒸発器から水平方向へ約 20cm 離れた所で測定した.

表 1 に Type A の場合の実験条件を示す。実験はフ ロリナートの液量 Fを 10~45cc(充填率 R=15~69%)。 ヒータへの供給電力 Qを 5~30V まで変化させて行い, 定常状態での測定を行った、なお、充填率 Rとは熱サ イフォンの全容積(65cc)に占める液の容積の割合のこ とである. 系は放熟部となる凝縮器裏面を除き全て断 熱されている. なお, 蒸発器からの熱損失は 3%程度 と推定され、供給熱量のほとんどは冷媒によって運ば れている。しかし、凝縮器裏面からの自然対流および 放射による放熱量を見積もると供給熱量の 60%程度と なっており、残りは凝縮器側面のアクリル板等から放 熟されている. 蒸発器および凝縮器内の圧力測定には 900milig まで測定できるパルミル真空計(PVD9500)を用 いた. なお、Type B~D の場合には本装置で最適な液 量と考えられる F=20cc と固定して Qを変化させて実 験を行った、実験はそれぞれの実験条件で3回ずつ行 い, それらの平均値を結果として示す.



(c) Heater back surface



(d) Condenser inside (e) Condenser back surface

Fig. 4 Location of temperature measurements

Table 1 Experimental conditions (Type A)

F [cc]	R [%]	Q [W]
10	15	5, 10, 15, 20, 25, 30
20	31	5, 10, 15, 20, 25, 30
30	46	5, 10, 15, 20, 25, 30
45	69	10, 20, 30

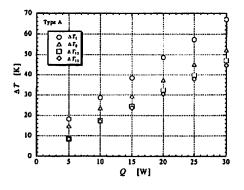


Fig. 5 Effect of heat input on temperature (Type A, F=20cc)

## 3. 実験結果および考察

図 5 に Type A の平滑面蒸発器 3・1 熱量の影響 を用いた場合の機器内温度におよぼす熱量の影響を示 す.図中のΔ7, (○)は CPU 温度に対応する蒸発器裏面温 度, ΔΤ, (Δ)は蒸発器内の温度, ΔΤ, (□)は凝糖器内の 退度, ΔT<sub>13</sub> (◇)は凝縮器裏面温度であり、それぞれ周 囲温度 7 との差で表している. なお, これらのプロッ ト点は 3 回の測定値の平均値を示しているが、最大で ±IK 程度のばらつきがある。各温度とも熱量の増加と ともにほぼ直線的に増加している. 本実験の最高熱量 である Q=30W において、Δ7、(=T-T)は 67K 程度であ る.  $\Delta T_a(\Delta)$ および $\Delta T_{12}(\Box)$ はそれぞれ蒸発器および疑 縮器内の蒸気あるいは二相流の温度を表すが、閉ルー プ内の循環の周期によって、それぞれ±0.2K 程度の混 度変動がある. また. これらの間には 5K 程度の温度 差があり、それは蒸気が凝縮器へ遠するまでの銅管内 を上昇する時の熱損失によるものである.

図 6 は Type A 蒸発器内の沸騰の様子をビデオカメラで撮影した画像である。蒸発器内の底面において沸騰は起こっておらず、側面の固液界面上端部においてわずかな気泡発生がみられる。蒸発器裏面温度 5 をさらに低下させるためには蒸発器内の蒸発・沸騰を促進させる必要がある。

図7に Type A の蒸発器裏面と 3・2 液量の影響 周囲との温度差AT。におよぼす閉ループ内の充填液量 F の影響を示す。 Q=10W の場合を除き、液量 Fによらず ΔT はほぼ一定である. ただし, F=10cc の場合, Q= 30% に加熱すると蒸発器内の液がほとんどなくなって しまう場合があったので、高熱量時には注意が必要で ある. Q=10W の場合, F=10, 20cc の場合のΔ7,は F= 30, 45cc の場合に比べ, 約 15%低下している. これ は閉ループ内の液の循環型が異なるためである. 循環 量が減少すると蒸発器へ流入する凝縮器で冷却された 疑縮液量が減るため蒸発器の温度は上昇する. Q=10₩ の場合, F=10, 20cc の場合には疑縮器からの液が蒸 発器に戻ってくる時間間隔が約 2 秒未満であるのに対 し. F=30, 45cc の場合には 4 秒以上となり, 液の循 **聚量が低下していることが確認できた.これは液量が** 多い場合、蒸発器から凝縮器へ通じる銅管内で液相が 占める領域が増加し、蒸気相が縮小し、循環の駆動力 が低下するためである。この現象は蒸発量が少なくな る, 加熱量が低い場合に顕著に現れる.

3·3 **無発器形状の影響** 図 5 から明らかなよう に Type A の蒸発器では、Q=30W の場合、蒸発器裏面



Fig. 6 Boiling pattern in evaporator (Type A) (Q=20% and F=45cc)

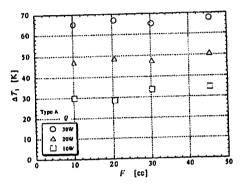


Fig. 7 Effect of charged volume of Fluorinert liquid on temperature  $\Delta T_i$  (Type A)

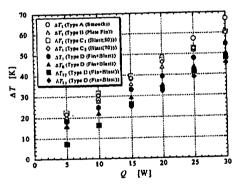


Fig. 8 Effect of evaporator type on temperature

温度 7, (○)と凝縮器裏面温度 7, (◇)の差が約 22K と大きい. これは図 6 に示したように不活発な蒸発・沸騰によるものである。そこで、7, の低下を図るために、新たに 3 種類の蒸発器を製作し、蒸発器形状による沸騰機相の違いを関べた。

図8に4種類の蒸発器について蒸発器裏面と周囲と の復度差点1,の測定結果を示す.また、Q=20W の場合

の蒸発器内の沸騰の様子を図 9(a)~(d)に示す. 図 8 において、Type D のフィン+プラスト式蒸発器につい ては、図 5 の場合と同様に $\Delta T_8$ 、 $\Delta T_{12}$ 、 $\Delta T_{13}$ のデータも プロットしている. これらの値は図 5 の Type A の場 合の $\Delta T_8$ ,  $\Delta T_{12}$ ,  $\Delta T_{13}$  の値とほとんど変わらない. この ことは Type B, C の場合でも同様である. Type A の場 合のΔ7<sub>1</sub>(○)に比べ, Type B のフィン式蒸発器の場合 (△)は全体的に低くなっている. これは、 Type A の 場合の不活発な沸騰に比べ、 Type B の場合はフィン 側面での気泡核生成が増加した(図 9(a)参照)ことによ る. Type C のブラスト式蒸発器の場合は、底面からの 沸騰が促進される. Type C, の場合(□)および Type C, の場合(◇)は、4 が約 15% までは沸騰はあまり見られ ず, Type A の場合(○)とほとんど変わらないが, 20W を超えると、底面からの沸騰が起こり(図 9(b)、(c)参 照),温度が急激に低下し,Type B の場合(△)とほぼ 同じ値を示す、また、Type C, と Type C, の間にはほと んど差異がなく、この程度の粗さの範囲(約 50~70µm) では粗さの違いによる影響はないと替える. Type B および Type C の特徴を併せ持つ形状のフィン式蒸発 器にプラスト加工した Type D の蒸発器についての結 果(●)は,他の形状の蒸発器に比べ,最も低い温度を 示している. 本実験で最高熱量の Q=30W において, 約 55K で、Type A の平滑面の場合(〇)より約 18%低 ・下している. 図 9(d)は Type D の場合の沸騰の様子で ある. 写真でははっきりしないが, 図 9(a)の Type B の場合より気泡発生数は増えていることが確認された. これまでエッチング等の加工技術を用いた微細構造に よる沸騰促進が報告されている(5)が、このような簡単 な加工方法(プラスト)を用いて伝熱面に粗さをつける ことによっても、伝熱面温度の低下に有効な結果が得 られることが確かめられた.

図 10 に本測定結果を沸騰曲線の形にまとめて示す. 熟流東 q はヒータへの供給電力 Q およびヒータと蒸発器の接触面積  $(0.05^2 \, \mathrm{m}^2)$  で定義される. 圧力計の測定限界のため、 $Q=200^\circ$  前後までの測定値をプロットしてある. なお、Q によって系内の圧力は  $400\sim800$  mmitg 程度変化するため、飽和温度  $T_{\mathrm{rat}}$  も  $40\sim60$   $^\circ$  程度に変化する. 測定結果は全体的に実線で示される自然対流の傾きとほぼ平行であり、自然対流域にあるが、Type  $C(\Box, \diamondsuit)$  の高熱流東域においては傾きが急になっており、核沸騰域に入っている. Type A から Type D  $\sim$  と沸騰が促進されるよう蒸発器を改良した結果、蒸発器内の発泡点密度が増加し、伝熱面過熱度  $\Delta T_{\mathrm{at}}$   $(=T_1-T_{\mathrm{rat}})$  が低下している.

図 11 に赤外線カメラを用いて撮影した凝縮器裏面

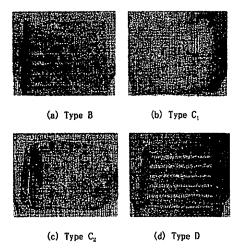


Fig. 9 Boiling pattern in evaporator (Q=20W and F=20cc)

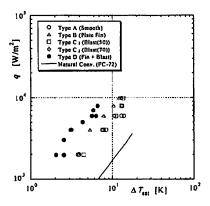


Fig. 10 Boiling curve

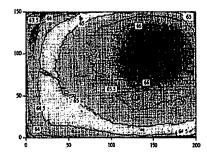


Fig. 11 Back surface temperature distribution of condenser (Type B) (Q=30W and F=20cc)

全体の温度分布を示す。図中の実線は 0.5K 毎の等温 線を表している。蒸発器からの蒸気が流入する右上部 の温度が最も高くなっている。しかし、本実験の最高 熱量である Q=30W においても左下の低温部との差は 約 2K(約 3%)程度であり、凝縮器全体でほぼー様温度 とみなすことができる。

冷却システムの性能評価を行う際、伝熱面積、システム容積、製造コスト等総合的に評価する必要があると思われるが、一つの指標として次式で定義される熱抵抗による比較を図12に示す。

 $\theta = (T_1 - T_2) / Q = (T_1 - T_{13}) / Q + (T_{13} - T_2) / Q$ 

図には比較のため、フジクラ製の RHE (Remote Heat Exchanger) &ヒンジシステムの熱抵抗(16) および日立製作所製の水冷パソコンの熱抵抗(16) およびロットしている。フジクラ製のものは循環ループをもたない従来からの技術を組み合わせた冷却方法であり、この中では一番高くなっている。本実験結果は日立の水冷システムより全体の熱抵抗θが高くなっているが、それは放熱板となる凝縮器の面積が日立の場合より約1/3 と小さいために凝縮器の温度が高くなったためである。凝縮器の対流熱抵抗を除く蒸発器と凝縮器間の冷却システム内での熱抵抗(=(T<sub>1</sub>-T<sub>12</sub>)/Q)のみを比較すると、本実験結果は日立のシステムより大幅に低い、凝縮器の面積を同じにすれば、全体的な熱抵抗が十分低くなることが予想され、本システムはノート型パソコンの冷却に応用できると考える。

#### 4. 結 言

二相閉ループ型熱サイフォンを用いた自然循環方式 による CPU の冷却に関する実験を行った。CPU 温度に 対応する蒸発器裏面退度 Tにおよぼす加熱量、充填液 量および蒸発器形状の影響を実験的に関べた。以下に 主な結果を列挙する。

- (1) 蒸発器裏面温度 八はヒータへの供給電力 Qの増加 とともにほぼ直線的に増加する.
- (2) 蒸発器裏面温度 T<sub>1</sub> は Q=10W の場合を除き、閉ループ内の充填液量 Fによらずほぼ一定である。
- (3) フィン式、ブラスト式と蒸発器内の沸騰を促進させることにより、CPU 温度を大幅に低下させることができることを明らかにした、Type Dの場合の T,はType A の場合に比べ約 18%低下した。
- (4) 本システムの熱抵抗は実用化されているシステム に比較しても十分低く、有効な冷却方法の一つに なりうる。

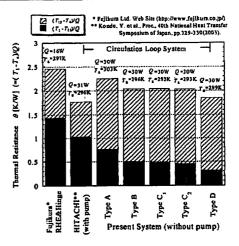


Fig. 12 Comparison of thermal resistance

おわりに、本研究の遂行に当たり、琉球大学 屋良 秀夫 教授には、蒸発器のブラスト加工にご協力頂き、 また琉球大学 親川 兼勇 教授には赤外線カメラの使用 に便宜をはかって頂いた、ここに謝意を表します。

#### 文 献

- (1) 石塚, 日本機械学会誌, 105-998 (2002), 31-34.
- (2) 望月・益子・後藤・斎藤・高宮、第34回日本伝熱シンポジウム講演論文集、1(1997)、241-242.
- Remesweny, C., Joshi, Y., Nakayema, W. and Johnson, W. I., Proc. 11th Int. Heat Transfer Conf., 2 (1998), 127-132.
- (4) Webb, R. L. and Yamauchi, S., Proc. InterPACK' 01 (CD-ROM), IPACK2001-15773 (2001), 1-9.
- (5) Honda, H., Takamastu, H. and Wei, J. J., Trans. ASME, J. Hest Transfer, 124 (2002), 383-390.
- (6) Palm, B. and Khodabandeh, R., Trans. ASME, J. Electronic Packaging, 125(2003), 276-281.
- (7) 大串・山蔭・加茂谷・高田,第40回日本伝熱シンポジウム課演論文集,3(2003),747-748.
- (8) 近藤・大橋・松下、第40回日本伝熱シンポジウム課演 験文集、1(2003)、329-330.
- (9) 石塚, 日本機械学会誌, 105-1006 (2002), 6-7.
- (10) Gima, S., Tomimura, T., Zhang, X. and Fujii, M., Advances in Electronic Packaging 1999, EEP-26. 2(1999), 1479-1484.
- (11) 儀間・宮村・張・藤井、日本機械学会熱工学講演論文集。 No. 99-25 (1939)、37-38.
- (12) 儀閒・富村・張・摩井,九州大学機能物質科学研究所報告,13-2 (1999),75-80.
- (13) Gima, S., Tomimure, T., Zhang, X. and Fujii, M., Proc. 4th JSME-KSME Thermal Eng. Conf., 1 (2000), 681-686.
- (14) Gima, S., Nageta, T., Zhang, X. and Fujii, M., Proc. InterPACE '03 (CD-ROM), IPACK2003-35148 (2003), 1-6.
- (15) 機間・長田・張・藤井,日本機械学会2003年度年次大会講演論文集、No.03-1、VI(2003)、249-250.
- (16) 株式会社フジクラホームページ, http://www.fujikura.co.jp